INFORMATION RECORDING MEMBER

Publication number: JP57027788

Publication date:

1982-02-15

Inventor:

NAKAO MASABUMI; MORI KOUIÇHI

Applicant:

ASAHI CHEMICAL IND

Classification:

- International:

B41M5/26; G11B7/241; G11B7/243; B41M5/26;

G11B7/24; (IPC1-7): B41M5/26; G11B7/24; G11C13/04

- european:

G11B7/243

Application number: JP19800102101 19800725 Priority number(s): JP19800102101 19800725

Report a data error here

Abstract of JP57027788

PURPOSE:To obtain a heating mode recording member having a high recording sensitivity, a high S/N ratio for recorded information, good stability, and a low toxicity, by providing a layer consisting of a specific metal and a specific metal compound on an upper layer of a low-toxic metallic recording layer provided on a base material. CONSTITUTION:On the surface of a base plate or film, e.g., of polyester or polymethylmethacrylate, a metal oxide stabilizing layer, e.g., of SiO2, Al2O3, GeO2, Sb2O3, ZrO2, PbO, ZnO, MgO, TiO2, or CeO2, and a low-toxic metallic recording layer, e.g., of In, Bi, Sn, or Pb, are laminated in this order and then on an upper layer of the recording layer, a metal/metal compound mixed layer, e.g., a mixture of Al, Si, Ti, V, Mn, Fe, etc. with SiO2, GeO2, Al2O3, etc. is provided to manufacture an information recording member suitable for a heating mode recording method.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭57-27788

⑤Int. Cl.³
B 41 M 5/26
G 11 B 7/24
G 11 C 13/04

識別記号

庁内整理番号 6906—2H 7247—5D

7343-5B

❸公開 昭和57年(1982)2月15日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

匈情報記録用部材

20特

願 昭55-102101

②出 願 昭55(1980) 7月25日

⑫発 明 者 中尾正文

富士市鮫島2番地の1旭化成工 業株式会社内 ⑩発 明 者 森晃一

富士市鮫島2番地の1旭化成工 業株式会社内

⑪出 願 人 旭化成工業株式会社

大阪市北区堂島浜1丁目2番6

号

個代 理 人 弁理士 阿形明

明 細 書

1. 発明の名称 情報記録用部材

2. 特許請求の範囲

1 基板上に金属酸化物安定化層、低毒性金属 記録層を順次積層した構造を有する情報の記録 用部材において、該記録層の上層部に金属と金 風化合物とから成る混合層を有することを特徴 とする情報記録用部材。

2 混合層を形成する金属が、A1、Si、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Sr、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Ag、In、Sn、Sb、La、Hf、Ta、Re、Ir、T1、Pb、Bi、Dy、Er、Gd、Nd、Pr、Sm、Mo、Au、Se又はTeもしくはこれらの混合物である特許請求の範囲第1項記載の部材。

3 混合層を形成する金属化合物が、Be、B、 Mg、Al、Si、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、 Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Sr、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Ag、In、Sn、Sb、Ba、La、Hf、Ta、Re、Ir、Tl、Pb、Bi、Dy、Er、Gd、Nd、Pr又はSm の酸化物もしくはフッ化物又はこれらの混合物である特許請求の範囲第1項記載の部材。

3. 発明の詳細な説明

本発明はヒートモード記録法に好適な情報記録用部材に関するものである。

従来、レーザー光線などの高密度エネルギーを スポットに集束させて記録媒体に照射し、媒体の 一部を融解変形したり、蒸発除去したりして記録 する方法が、ヒートモード記録法として知られて いる。

このヒートモード記録法は、薬品などの処理液を必要としないドライタイプであること、リアルタイム記録であること、高速かつ高コントラストで大容量記録が可能なこと、及び情報の追加書き込みができることなど多くの利点を有しているの

で、マイクロ画像、COM、ビデオデイスク、コン ピューターメモリーなど幅広い応用が考えられて いる。

これまでに知られているヒートモート記録法に は、情報をレーザー光線による物質の化学的変化 例えば酸化度の変化、光の吸収率あるいは反射率。 の変化として記録するものと、レーザー光線を照 射して記録媒体を部分的に蒸発、変形させてでき る孔として記録するものとがある。前者の記録法 においては、その記録材として金属酸化物が用い られているが、これは、一般にその記録感度が低 く、光の吸収率あるいは反射率の変化比率が小さ いため、高い S/N (信号/雑音) 比を得られない 欠点がある。他方、後者の記録法においては、記 録材として染料や色素を含有したプラスチックあ るいは金属が単一膜層として用いられるか、これ に上部保護層を付加して用いられている。しかし ながら、いずれのものも、その安定性、毒性ある いは S/N比などの点で問題があつた。

本発明者らは、記録感度が高く、記録された情

リマー、プレンド物などの有機材料から成るフィルム又は板をあげることができる。ビデオディスクなどのように基板自体の表面平滑性が信号のS/N比に大きな影響を与える場合には、別の基板上に上記の材料をスピンコートなどで均一に塗布した基板を用いることが好ましい。

特に好ましく用いられる基板としては、ポリエステル又はポリメチルメタクリレートから成る板及びフイルムをあげることができる。

本発明の部材は、との基板の上面に金属酸化物層を有している。

金属酸化物安定化層を形成するために用いられる金属酸化物としては、Be, B, Mg, Al, Si, Ga, Sc, Ti, V, Cr. Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga. Ge, As, Sr. Y, Zr, Nb, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, In, Sn. Sb, Ba, La, Hf, Ta, Re, Ir, Tl, Pb, Bi, Dy, Er, Gd. Nd, Pr, Sm などの金属の酸化物、特にSi, Al, Ge, Sb, Zr, Ta, Bi, Pb, Zn, Li, Mg, Ti, La, Ce. Y, Dy, Er, Gd, Hf, Sm, Cr, Nd, Pr など

報が高い S/N 比を示し、安定性が良好で、かつ低 毒性のヒートモード記録用部材を開発すべく鋭意 研究を重ねた結果、基体上に設けた低毒性金属記 録層の上層部に特定の金属及び金属化合物から成 る層を設けることにより、その目的を達成しうる ことを見出し、この知見に基づいて本発明をなす に至つた。

すなわち、本発明は基板上に金属酸化物安定化層、低毒性金属記録層を順次積層した構造を有する情報の記録用部材において、該記録層の上層部に金属と金属化合物とから成る混合層を有するととを特徴とする情報記録用部材を提供するものである。

本発明の部材において、金属酸化物安定化層、 低毒性金属記録層及び混合層の支持体である基板 としては、ガラス、マイカ、アルミニウム合金な どの無機材料又はポリエステル、ポリブロピレン、 ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、 ポリスチレン、ポリメチルメタクリレートなどの ポリマー、あるいはこれらの変性ポリマー、コポ

の金属の酸化物が好ましく用いられる。

特に好ましい金属酸化物としては、 5102, A120g, GeO2, Sb2O3, ZrO2, Ta2O3, B12O3, PbO, ZnO, LiO, MgO, TiO2, La2O3, CeO2, Y2O3, Dy2O3, Er2O3, Gd2O3, HfO2, Sm2O3 をあげることができる。

金属酸化物安定化層は、これらの金属酸化物の 二種類以上を用いて、異種金属酸化物の2層構造 にすることが情報記録として形成される孔の形状 を整え、その安定性を図るうえで好ましい。

金属酸化物安定化層を形成する方法としては、 真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーテ イング法、プラズマ蒸着法などの薄膜形成技術を 適用することができる。また、異なる単一金属か らなるターゲットの複数個や、2種以上の金属を 含むターゲットを用い、空気、酸素、酸素ーアル ゴンなどの気体による反応性スパッタリングによ つても形成することができる。

薄膜の形成方法、例えば高真空下での電子ビー ム蒸着において、低級酸化物、例えばGeO1~2が 金属酸化物安定化層に含まれる場合があるが、本 発明の目的を妨げない範囲において差し支えない。

このような低級酸化物の生成を防止するには、 酸素、空気、酸素-アルゴンなどの気体をリーク して低真空下で蒸着するなどの方法がある。

金属酸化物安定化層の膜厚は、用いる化合物の種類にもよるが、厚過ぎるとクラックを生じたりするので、10Å~10000Å,特に20Å~300Åの範囲が好ましい。

本発明の部材は、この金属酸化物安定化層の上面に低器性金属記録層を有している。

この金属記録層を構成する金属としては、記録材料としてすでに知られている全ての金属を用いることができるが、本発明の目的に従い低毒性の金属、例えばIn, Bi, Sn, Zn, Pb, Mg, Au, Ge, Ga, Sb, Rh, Mn, A1 などが好ましく用いられる。そのなかでも、In, Bi, Sn, Pb などは低融点であり低反射率なので記録感度が高く、特に好ましい。また、このような金属を、共晶を生じ融点が低下するような組合せで、2種以上組

から、高真空下、特に io⁻⁵ Torr以下での蒸着が 好ましい。

金属記録層の膜厚は、用途に応じて決められるが、約100 Å~5000 Å、特に 200 Å~600 Åの範囲が好ましい。

本発明の部材は、との金属記録層の上層部に金属と金属化合物とから成る混合層を有する。

この混合層の形成に用いられる金属としては、 金属化合物と混合膜をつくるものであればよく、 好ましいものとしては、A1、Si、Sc、Ti、V、 Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Sr、 Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Ag、In、Sn、 Sb、La、Hf、Ta、Re、Ir、T1、Pb、Bi、Dy、 Er、Gd、Nd、Pr、Sm、Mo、Au、Se、Te をあ げることができ、その一種又は二種以上が用いら れる。

他方、金属化合物としては、金属と混合膜を形成するものであればよく、好ましいものとしては、Be、B、Mg、Al、Si、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Ca、Zn、Ga、Ge、As、Sr、

み合せて用いでもよい。

本発明において、金属記録層は、単一層であつても、複数層であつてもよい。特に2種以上の金属を組み合せて用いる場合には、2種以上の金属の合金からなる単一層であつても、数種類の単一金属層が積層された複数層であつても、合金層と単一金属層が積層された複数層であつてもよい。記録された情報の孔形状を特に乱れのないものとするためには、数種類の単一金属層を積層したものが好ましい。

金属記録層には、本発明の目的を損わない限り、 用いた金属の酸化物、特に低級酸化物を少量含ん でいてもよい。

この金属記録層は、真空蒸着、スパッタリング、 イオンプレーテイング、電気めつき、無電解めつ き、プラズマ蒸着などの薄膜形成技術によつて形 成しうる。

これらの金属記録層の形成方法のうち、 真空蒸 着法が簡単でかつ再現性がよいので好ましいが、 金属記録層の高温高湿下での安定性及び感度の点

Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Ag、In、Sn、Sb、Ba、La、Hf、Ta、Re、Ir、T1、Pb、Bi、Dy、Er、Gd、Nd、Pr、Smの酸化物又はフッ化物をあげることができる。より好ましい金属化合物は、A1203、ZrO2、Cr2O3、GeO2、S1O2、Bi2O3、AB2O3、Sb2O3、Ta2O3、Sm2O3、Y2O3 などであり、特にガラス形成酸化物例えばS1O2、GeO2、A12O3 などは、非晶性で網目構造をとるので遮断性に優れ、金属記録層の酸化劣化を防ぎ、安定化に有効である。混合層の形成にはこれらの金属化合物の一種又は二種以上が適宜組合わされて用いられる。

本発明部材において、混合層は誘電媒質としての金属化合物中に、金属を照射光の波長よりもその径が小さい微粒子として分散する構造をしていることが好ましい。このような構造は、 微粒子として分散する金属と支持体としての金属化合物との組合せを、分散金属の酸化物又はフッ化物の生成自由エネルギーよりも大きい関係にあるものとした場

合に、比較的容易に得ることができる。

混合層の形成は、金属と金属化合物とをそれぞ れ別個の蒸着用ボートあるいはエレクトロンビー ム蒸着ルツポに置き、共蒸着又は共スパツタリン グさせることにより行うことができる。また、金 属と金属化合物との混合ペレットを用いて抵抗加 熱方式、エレクトロンビーム蒸着方式、イオンプ レーティング方式など公知の薄膜形成方式によつ ても行うことができる。これらのうち、真空蒸着 方式が簡便にこの目的を達成できるので好ましく、 10⁻⁵ Torr以下の高真空条件下においては、安定 な混合層を得ることができる。

との混合層の厚さは、 50~1000 A、好ましく は100~800 Aの範囲であり、混合層中の金属微 粒子の全体積は混合層全体の10~80%、好ま しくは20~60%の範囲である。この範囲を食 み出ると、本発明の効果である連続発振出力が 10mw 以下で、その発振波長が近赤外領域の波 長である半導体レーザーを照射光原として利用す ることができなくなる。

との透明保護層は、機械的損傷の防止に役立つ ばかりでなく、適当な膜厚を設定すれば、反射率 を低減させる作用を有するので記録用部材の感度 上昇にも役立つ。

透明保護層は、有機高分子化合物を主体とした **層で形成され、用いられる有機高分子化合物とし** ては、例えばポリ塩化ビニリデン、塩化ビニリデ ンとアクリロニトリルとの共重合体、ポリ酢酸ビ ニル、ポリイミド、ポリビニルシンナメート、ポ リイソプレン、ポリプタジエン、ポリスチレン、 ポリメチルメタクリレート、ポリウレタン、ポリ ビニルプチラール、フツ累ゴム、ポリアミド、ポ リエステル、エポキン樹脂、酢酸セルローズなど のポリマー、これらの変成ポリマー、コポリマー などをあげることができ、これらは単独で又は混っ 合物として用いられる。

特に、ポリエステル、フツ累ゴム、ポリ酢酸ビ ニルーポリビニルプチラールーポリビニルアルコ - ルの三元コポリマーが好ましく用いられる。

とのような有機高分子化合物にシリコーンオイ

狩開昭57-27788(4)

本発明において混合層は、低毒性金属記録層の 上面に直接設けてもよく、他方、金属化合物安定 化層を介して設けてもよい。この低毒性金属記録 層と混合層との間に設ける金属化合物安定化層は、 低毒性金属記録層の変質を防止するために設ける ものである。

との金属化合物安定化層の形成に用いる金属化 合物としては、A1、Ge、Zr、Si、Ti、Ce、Ta、 La, Cr, Y. Dy, Er, Gd, Hf, Sm, Bi, Pb, Zn、Li、Mg、Sb、Pr、Ndの酸化物、窒化物又 は弗化物などをあげることができる。この層の構 成を異種金属化合物による二層構造とすることが、 情報記録として形成される低毒性金属記録層の孔 の形状を整えその安定性を図るうえで好ましい。 また、この層の厚さは、10~1000 A、特に20 ~ 300 Å の範囲が適当であり、層の形成には金属 酸化物安定化層の形成方法と同様の方法を使用す ることができる。

本発明の部材は、混合層の上面に透明保護層を 有していてもよい。

ル、帯電防止剤、架橋剤などを添加することは、 膜強度、帯電防止性能の改良の点で好ましい。

透明保護膜層として、このような有機高分子化 合物を主体とする層を2層以上重ねて用いてもよ 500

透明保護膜層は、有機高分子化合物を主体とす る成分を適当な溶媒に溶解して塗布するか、ある いは薄いフイルムとしてラミネートするなどの方 法により形成され、膜厚は 0.1~1 0 μ が適当で ある。

本発明の記録用部材は、低春性で安定性にすぐ れ、高感度であるばかりでなく、記録された情報 の孔形状に乱れがなく、 S/N比が高く、かつ微細 なパターンを形成できるので、これをマスクとし て用い、ホトレジストを感光させてビデオデイス クのレプリカ用マスター板を作成することも可能 である。·また、照射光として、半導体レーザー、 キセノンフラツシユランプ、アルゴンガスレーザ -、その他可視領域、近赤外領域に発振波長をも つレーザーや各種ランプを使用することができる。 本発明の記録用部材に情報を記録する方法としては、レーザー光線をスポット、あるいは連続的に照射する方法及び適当なコントラストを有するマスクを通して、高強度のレーザー光線又はキセノンフランシュランプの短パルス光線などで照射して画像を形成する方法などがあげられる。

上記のマスクとしては、クロムマスク、ドライ シルパーフイルム、ジアゾフイルムなどが用いら れる。

次に実施例により本発明をさらに詳細に説明する。 なお、充てん率とは、混合層(全体を 1 とする)中で金属微粒子の占める体積の割合を意味する。

実施例1

キャスト法によつて作製した、表面平滑性のよいポリメチルメタクリレートの板を直径30cmのディスクに加工し、真空蒸着機槽内にセットする。ディスクは、装置の中央において回転できるようになつている。装置内には、回転の中心軸を中心として3つの加熱蒸着ポートと5つのルツボを持

ス幅に変調したレーザー光で記録を行つた。レーザー光の照射された部分は、楕円形の孔が開孔し、その短径はほぼ 1 μm であつた。混合層を形成しないサンプルのレーザー光に対する記録関値は、記録表面でのレーザー強度で 9 m W であつた。信号対雑音比(S/N比)は、スペクトルアナライザーで 1 M H2 のキャリア信号について測定したところ約 25 dB の値を得た。一方混合層を形成したザンプルについては、レーザー光の記録関値は 4 m W であり、S/N比は約 4 0 dB であつた。実施例 2

つ電子ビーム装置を備え、3つの加熱ボートにそ れぞれ、Bi、SnとAuを人れ、電子ビーム蒸着装 置のルッポには、Sm2O3とMgO を入れた。装置 内を 2 × 10⁻⁶ Torr の真空度とした後、基板回転 速度を 120 rpm とし、まず Sm2O3 を 100 Å 、次 いてBiを300 A、次にSnを100 Aの厚さで蒸着 した。最後に混合層を形成するために、 MgOとAu を同時に一様な混合層を形成するように蒸着し、 膜厚 300 Å、 充てん率 0.3 の混合層を形成した。 膜厚のモニターは水晶振動子法で行い、順次、自 動的にプログラムされた順序でコントロールされ、 蒸着操作は、2分以内にそのすべてが終了した。と の間、蒸滑機槽内の真空度は 2×10⁻⁶~3×10⁻⁶ Torr を示し、 酸化物の蒸着初期には 4 × 10⁻⁶ Torr 台を示した。 蒸着基板の意図的加熱は行つ ておらず、蒸滑による基板温度上昇もほとんどな かつた。

次に、半導体レーザーの光を記録面上にレンズ でピーム径1μm まで集光し、デイスクを 450 rpmの速度で回転させながら、 500 n sec のパル

0.3とした。こうして本発明の部材を得た。

・比較例として、混合層を形成せずに、同構造のサンブルに反射防止層としてポリエステルの 0.2 μm の 腹厚のポリマーをスピンコートにより塗布したものを作製した。

これらのサンプルを半導体レーザーで実施例 1 と同様に評価したところ、ポリマーをコートした サンプルのレーザー記録の閾値は、 4.5 m W であ つたが、混合層を形成したサンプルの閾値は 3.5 m W であり、孔は非常に良好な形状を示した。

このサンプルを高温高湿下に置き、加速劣化テストを行つた。混合層を形成したサンプルは、10数日後も感度、孔形状の変化は認められなかつたが、ポリマー層を形成したサンプルは、感度、孔形状ともやや劣化が認められた。また両サンプルとも、記録ずみの孔形状の劣化は認められなかつた。

実施例3

金属敏化物安定化層として、La₂0₅. 金属記録 層として B1 、金属化合物安定化層として GeO₂ を 選び、混合層としては SiO₂ と Ni を用いた。実施例 1 と同様に、ポリメチルメタクリレートのディスク上に 2×10⁻⁶ Torr の真空度で蒸着した。 各層の膜厚は、 La₂O₃ を 100 Å、 Bi を 400 Å、 GeO₂ を 100 Å とし、 SiO₂ と Ni の混合層は膜厚を 350 Å、充てん率は 0.4 とした。 このものについて、半導体レーザー光により記録評価を行つたところ、記録閾値は、 3.5 m W であつた。 記録孔形状もピット周囲について乱れなく形成された。

比較サンプルとして、SiO2 とNiの混合層に代えて、SiO2 1400 Aの反射防止層を形成したサンプルを作製した。このもののレーザー記録閾値は 5.0 m W であつた。記録孔形状は混合層を形成したサンプルに比べやや小さめであり、孔のエッジもやや乱れていた。

実施例4

金属酸化物安定化層として、A1₂0₃-Ge0₂の 2層膜、金属記録層としてBi-Snの積層膜、金 属化合物安定化層としてGeO₂を実施例1と同様 に作成した。混合層としてはA1₂O₃-Auの混合

GeO2 を80 A の順序で行い、GeO2 と Cr の混合 層は粉末を混合ペレット化し、エレクトロンビーム蒸 着により膜厚 300 Å、充てん率を 0.3 とした。 このものについて、半導体レーザー光により記録評価を行つたところ記録関値は 4.0 mW であり、記録孔形状も良好で、孔エッジ部も乱れなく記録された。

比較サンプルとして、 GeO2 と Cr 混合層を形成しないものを作製し、これにつき、レーザー記録 関値を測定したところ、 9.0 m W であつた。 実施例 6

120 μmのポリエステルフイルム上に、金属酸化物安定化層として、GeO2 を50Å、金属記録 層としてBi を300Å、PDを50Å設け、ついで金属化合物安定化層として、GeO2 を50Å設けた。次に混合層として、MgO と Ag の混合膜を膜厚300Å、充てん率が0.2 となるように、共スパッタリング法により形成した。混合膜以外の蒸剤は2×10⁻⁶ Torr の条件下で行つた。このフイルムに300本/mmの解像カチャートを焼き付けたク

膜を用いた。積層は Al₂O₃ を 50 A、 GeO₂ を 50 A、 Bi を 300 Å、 Sn を 200 Å、 GeO₂ を 50 Å の順 序で行い、 Al₂O₃ と Au は共蒸着により形成し、 混合層の膜厚は 400 Å、 充てん率は 0.5 とした。

とのサンブルについて半導体レーザーにより記録評価を行つたところ、記録閾値は3.0m™であった。また、記録孔形状も良好であり、孔エンジ部も乱れなく記録された。

高温高湿下での加速劣化テストでは、3週間後 も感度孔形状の劣化は認められなかつた。

比較例として、A1203 と Au の混合層のかわり に、ポリエステルポリマーを 0.2 μm の膜厚にス ピンナー塗布し、反射防止膜としたところ、反射 率は 5 2 %であり、レーザー記録閾値は 4.0 m W であつた。

実施例5

金属酸化物安定化層として Sm2O3, 金属記録層として Bi 単層、金属化合物安定化層として GeO2を変び、混合層としては、 GeO2 と Cr の混合層を用いた。積層は、 Sm2O3 を 8 0 Å、 Bi を 300 Å、

ロムマスクを密着させ、キセノンフラツシュランプを100μsecのパルス幅で照射したところ、解像力は250本/mmが得られた。またこのときの記録感度は、150mJ/cdであつた。比較例として、MgOとAgの混合層に代えてフツ素ゴム(商品名テクノフロン)をメチルエチルケトンに溶解したまり、変変布、乾燥し0.5μmの厚さに設けたサンブルを作製した。このフィルムについても同様にクロムマスクを密着させキセノンフラツシュランプで焼き付けたところ、解像力は250本/mmで本発明部材と同様であつたが、記録感が悪かった。

本発明部材サンブルの解像力の線のエッジはや やギザギザであつたが、金属記録層の金属が玉状 となり線内に残留することはなかつた。

これにより、マイクロフイシュ用記録材料や、 レーザーを用いたファクシミリ、レーザー COM用 記録材料への応用にも好適であることがわかつた。 明和 55年 9 日 35日

特許庁長官 - 特許庁後刊長 島 田 春 樹 殿

し事件の表示

昭和55年 特許願 第102101号

2. 発明の名称

情報記錄用部材

3. 補正をする者

すけどの関係 特許出願人

作 所 大阪府大阪市北区堂島浜 1 丁目 2 番 6 号 (003) 旭 化 成 工 業 株 式 会 狂 代表者。宫 崎 輝

1.代理/

〒 104 東京都中央区銀座6丁目4番5号 土崖ビル5階

(7182) 弁理士 阿 形 明.

5. 権正命令の日付 自発

6. 横正により増加する発明の数 **0** (2) (7)

7.Millの対象 明細書の発明の詳細な説明の欄

孔形状、感度等において期待するほどの効果が得 られない。 」

(8) 同第12ペーン第8行目の「としては、」の 次に以下の文章を加入します。

「Be、B、AL、Mg、Si、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Sr、Y、Zr、Nb、Te、Ru、Rh、Pd、Ag、In、Sn、Sb、Ba、La、Hf、Ta、Re、Ir、TL、Pb、Bi、Dy、Er、Gd、Nd、Pr、Smなどの元素の酸化物、窒化物又はフッ化物を、特に好ましいものとしては、」

(9) 同第14ページ下から3行目の「キセノンフラッシュランプ、」を削除し、末行の「各種ランプ」を「キセノンフラッシュランプなどの各種ランプ」に訂正します。

(d) 同第20ページ第13行目の「ピンナー…」 から第15行目「であつた。」を以下の文章に訂 正します。

「ピンナー塗布したサンプルを作製した。このサ ンプルの半導体レーザーによる記録**関**値は 4.0mW であり、孔形状はほぼ良好であつたが、孔エッジ 8.補正の内容

- (1) 明細書第3ページ第6行目の「酸化度の変化」を「酸化度の変化などによる」に訂正します。
- (2) 同第5ページ下から第7行目の「Ga」を「Ca」 に訂正します。
- (3) 同第6ページ第5行目の「Sm,O,」の次に「、 Cr,O,」を加入します。
- (4) 同第7ページ下から第5行目の「A∠」の次に「、To」を加入します。
- (5) 同第9ページ第10行目の「V、」の次に「Cr、」 を加入します。
- (6) 同第10ページ第5行目の「SiO₂、」の次に「SnO₂」を加入します。
- (7) 同第11ページ第4行目の「共蒸着又は」を「共蒸着するか又は各物質を」に、第16行目の「この範囲…」から末行「…なくなる。」を次の文にそれぞれ訂正します。

「この範囲をはみ出ると、連続発振出力が10mW 以下でその発振波長が近赤外領域の波長である半 導体レーザーを照射光顔として利用した場合など、

部は混合層形成サンブルに比べ乱れが見られた。」